

令和7年5月12日

利用者各位

機器分析センター

X線光電子分光装置 利用者講習会のお知らせ

機器分析センターでは今年2月に新しいX線光電子分光装置(XPS)を設置いたしましたので、下記要領で講習会を開催いたします。装置の利用を予定している方はご参加ください。

参加希望の方は、以下の参加申込書に必要事項を記入の上、5月22日(木)までに機器分析センター事務室に提出してください。整理の都合上、申込書1枚には1名分だけを記入してください。

なお、機器の利用申請書を提出していない方は、講習会時に利用申請書を提出してください。

参加申込書及び利用申請書は、機器分析センターHP (<https://clab.yamanashi.ac.jp/download/>) からダウンロードできます。

記

日 時 令和7年5月28日(水)

・午前の部 9:30~12:30 ・午後の部 13:30~16:30

午前と午後は同じ内容ですので、どちらかにご参加ください。

場 所 機器分析センター新館3階305号室

機 種 X線光電子分光装置(XPS)(ULVAC PHI・GENESIS)

講 師 研究機器統轄センター 篠塚 郷貴 技術職員

研究機器統轄センター 河村 隆之介 技術職員

内 容 装置の使用開始・終了手順、試料準備・分析室挿入、XPS測定(ワイドスキャン、ナロースキャン、デプスプロファイル)

形 式 現地参加とオンライン(Teams)のハイブリッドで行う予定です。

申込記入欄にどちらを希望するかチェックを入れてください。

※ 現地参加は人数の都合があるため、必ずしも希望に添えない場合があります。

※ また、その場合はオンライン参加をお願いすることがあります。

----- (切り取り線) -----

締切5月22日(木)

機器分析センター 宛

X線光電子分光装置 利用者講習会 参加申込書

所属研究室: _____ 参加者氏名: _____

メールアドレス or 学籍番号: _____

(参加してもらう部、形式、Teamsのアドレスの連絡に使用します)

希望する部

☐ 午前 ☐ 午後 ☐ どちらでも可

希望する形式

☐ 現地参加 ☐ オンライン(Teams) ☐ どちらでも可